

【主な研究施設・設備】

(全学)

■電子プローブマイクロアナライザ装置【日本電子(株)製】 **2016年2月導入**

・EPMA: JXA-8230 ・SEM: JSM-IT300 ・CP: IB-19510CP ・AFC: JFC-3000FC

■全自動X線分析装置

・XRD: SmartLab ・蛍光X線分析装置: Supermini ・携帯型成分分析計: NITON XL3t

(研究室)

■テンシロン万能試験機 バージョンアップ **2020年1月導入**

■ダイヤモンドワイヤー切断機 **2019年1月導入**

■熱サイクル酸化試験装置(特別仕様) **2018年7月導入**

■超音波厚さ計 **2018年4月導入**

■サーモグラフィカメラ **2016年6月導入**

■ハンディー硬さ計 **2016年5月導入**

■テトラアーク式引上装置

■アーク溶解装置

■高速昇温炉 ■真空熱処理炉(特別仕様)

■接合装置(赤外線ゴールドイメージ炉、真空排気装置)

■学生実験用熱分析装置(特別仕様)

■光学顕微鏡 ■マイクロスコープ(12台)

■ロックウェル硬さ試験機 ■ショア硬さ試験機

■ビッカース硬さ試験機 ■マイクロビッカース硬さ試験機

■卓上旋盤 ■円筒研削機

■湿式耐水研磨台(特別仕様) ■自動研磨機

■精密切断機 ■高速切断機

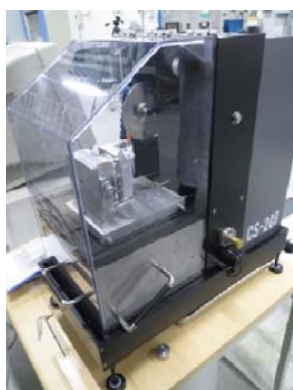
■ドラフトチャンバー



テトラアーク式引上げ装置



ロックウェル硬さ試験機



ダイヤモンドワイヤー切断機



真空熱処理炉



マイクロビッカース硬さ試験機